

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2024年11月28日(28.11.2024)



(10) 国際公開番号

WO 2024/241626 A1

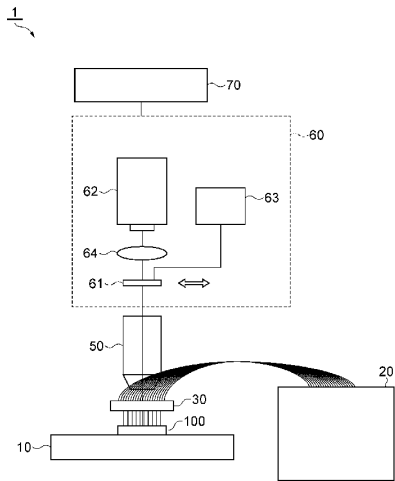
- (51) 国際特許分類:
G01N 21/88 (2006.01) *G01J 3/51* (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2024/001130
- (22) 国際出願日: 2024年1月17日(17.01.2024)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2023-083327 2023年5月19日(19.05.2023) JP
- (71) 出願人: 浜松 ホトニクス 株式会社 (HAMAMATSU PHOTONICS K.K.) [JP/JP];
〒4358558 静岡県浜松市中央区市野町 1 1 2 6 番地の 1 Shizuoka (JP).
- (72) 発明者: 中村 共則 (NAKAMURA Tomonori);
〒4358558 静岡県浜松市中央区市野町 1 1 2 6 番地の 1 浜松ホトニクス株式会社内 Shizuoka (JP).

- (74) 代理人: 長谷川 芳樹, 外 (HASEGAWA Yoshiaki et al.); 〒1000005 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号丸の内 M Y P L A Z A (明治安田生命ビル) 9階 創英国際特許法律事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG,

(54) Title: INSPECTION DEVICE AND INSPECTION METHOD

(54) 発明の名称: 検査装置及び検査方法

[図1]



(57) Abstract: This inspection device performs the inspection of semiconductor devices and comprises: a stage that holds a semiconductor device; an LRG filter that has transmission characteristics whereby the transmittance changes linearly in a prescribed wavelength range, and that, on the basis of these transmission characteristics, transmits or reflects light emitted at the semiconductor device; an infrared camera that images light traversing the LRG filter and outputs a transmission image, and that images emitted light arriving without going through the LRG filter and outputs a full light image; and a computer that derives wavelength information for the emitted light on the basis of the transmission image and the full light image.

(57) 要約: 検査装置は、半導体デバイスを検査する検査装置であって、半導体デバイスを保持するステージと、所定の波長域において透過率が線形に変化する透過特性を有し、半導体デバイスにおいて発生した発光を、透過特性に基づいて透過又は反射するLRGフィルタと、LRGフィルタを透過した光を撮像し透過画像を出力すると共に、発光であってLRGフィルタを介さずに到達した光を撮像し全光量画像を出力する赤外カメラと、透過画像及び全光量画像に基づいて、発光の波長情報を導出するコンピュータと、を備える。

[続葉有]

ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類：

- 一 国際調査報告（条約第21条(3)）